

Винахід належить до інженерної геодезії. Спосіб контролю висотних відміток деформаційних марок ґрунтується на фотоелектричній реєстрації відносного положення трьох суміжних марок. При цьому фотоелектричний вимірювальний прилад (ФЕП) з'єднують з посадковою конструкцією деформаційної марки, світлові випромінювачі з'єднують також з сусідніми по обидва боки від ФЕП деформаційними марками, а світлові потоки від світлових випромінювачів направляють в об'єктив ФЕП і вимірюють різницю кутових відхилень зображень світлових випромінювачів в полі зору ФЕП, потім ФЕП переставляють на сусідню марку за напрямом нівелірного ходу, а світлові випромінювачі переставляють також на сусідні по ходу марки і виконують вимірювання, аналогічне попередньому. Далі повторюють описані операції по всьому нівелірному ходу, а за отриманими різницями кутових відхилень зображень світлових випромінювачів на всіх деформаційних марках, включаючи марки на опорних реперах, розраховують і зрівнюють значення висотних відміток деформаційних марок і порівнюють ці значення з отриманими у попередньому черговому циклі значеннями вимірів. Технічним результатом є скорочення ручних операцій за рахунок виключення візуальних вимірювань, що дозволяє отримати суттєвий техніко-економічний ефект.